

# Sputter Kaplama Sistemi SAT (Kabul Prosedürü)

## 1. Genel Kabul

Test	Açıklama	Test Yöntemi	Kabul Kriteri
Dokümantasyon	CE ve teknik dokümanların kontrolü	Doküman inceleme	Eksiksiz
Kurulum	Sistem kurulumu kontrolü	Gözlem	Çalışır durumda
Eğitim	Operatör eğitimi	Gözlem	Tamamlanmış

## 2. Vakum Sistemi

Test	Açıklama	Test Yöntemi	Kabul Kriteri
Pump-down	Atmosferden vakuma çekme	Ölçüm	$\leq 5 \times 10^{-7}$ mbar
Ultimate vacuum	Son vakum seviyesi	Gauge ölçümü	$\leq 5 \times 10^{-7}$ mbar
Leak test	Kaçak kontrolü	Basınç takibi	Stabil

## 3. Gaz ve Basınç Kontrolü

Test	Açıklama	Test Yöntemi	Kabul Kriteri
MFC doğruluk	Gaz akış doğruluğu	Karşılaştırma	$\pm 1\%$
Multi-gas	Çoklu gaz kontrolü	Test	Stabil
Basınç	Plazma sırasında basınç	Ölçüm	Stabil

## 4. Sputter Kaynakları

Test	Açıklama	Test Yöntemi	Kabul Kriteri
RF plasma	RF ile plasma	Test	Stabil
DC plasma	DC ile plasma	Test	Stabil
Co-sputtering	Çift kaynak	Test	Çalışır

## 5. Isıtma ve Substrat

Test	Açıklama	Test Yöntemi	Kabul Kriteri
Sıcaklık	800°C kontrol	Ölçüm	$\pm 1^\circ\text{C}$
Rotation	Tabla dönüşü	Test	0–30 rpm

## 6. Kalınlık Ölçüm

Test	Açıklama	Test Yöntemi	Kabul Kriteri
Kalınlık ölçüm	Depozisyon sırasında ölçüm	Test	Sürekli veri
Doğruluk	Referans ile karşılaştırma	Ölçüm	$\leq 5\%$

## 7. Yazılım ve Otomasyon

Test	Açıklama	Test Yöntemi	Kabul Kriteri
Recipe	Reçete çalıştırma	Test	Sorunsuz
Logging	Veri kaydı	Kontrol	Eksiksiz
User	Kullanıcı yönetimi	Test	Doğru

## 8. Güvenlik

Test	Açıklama	Test Yöntemi	Kabul Kriteri
EMO	Acil stop	Test	Sistem durur
Interlock	Kapı açma	Test	Plasma kapanır
Water fail	Su kesilmesi	Test	Sistem durur

## 9. Performans

Test	Açıklama	Test Yöntemi	Kabul Kriteri
Uniformity	Film homojenliği	Ölçüm	$\leq 5\%$
Repeatability	Tekrarlanabilirlik	Test	Tutarlı
Stability	Uzun süre çalışma	Test	Stabil